

モトール・フェイズ I ポイント・オブ・ユース精製装置は、半導体関連分野用に設計された、ゲッター方式の超高純度ガス精製装置です。

精製装置出口ガス中の、 $O_2$ 、 $H_2O$ 、 $CO$ 、 $CO_2$ 、 $H_2$ 、 $CH_4$  (希ガス用では  $N_2$  も含む) 等の不純物を 1ppb レベルまで除去します。

精製装置は電解研磨処理された内表面、ゼロデッドスペース、簡単なガス供給ラインへの接続の特徴があります。

装置は高さ 58cm と円周 10cm のゲッター筒と入口・出口それぞれに UHP ダイヤフラム手動弁が設置され、 $0.003 \mu m$  オールメタルフィルターと組み込み式電子制御ユニットから構成されています。

ゲッター筒の寿命は、入口不純物の濃度と流量で決まります。通常、ファイブナイン(99.999%)か、それ以上の入口純度のガスを使い 1 年以上の寿命となります。

使用されているゲッター材の動作温度は  $350^\circ C$  ~  $400^\circ C$  程度ですが、停電が発生した場合でも、最高 1 週間程度までは精製が維持されます。

#### 用途

- ・分析ゼロガス、キャリアガス
- ・フォトリソグラフィー
- ・R&D ラボラトリー
- ・シリコンエピタキシー ・溶接ガスの精製
- ・配管システムのドライダウン
- ・インプラント ・光ファイバー
- ・放射能検出器 ・ $H_2/He$  FID 燃料
- ・人工衛星の貯蔵ガス

#### 精製対象ガス

- ・アルゴン、ヘリウム、その他の希ガス
- ・窒素

#### 対象除去不純物

- ・ $O_2$ 、 $H_2O$ 、 $CO$ 、 $CO_2$ 、 $H_2$ 、 $CH_4$ 、 $N_2$
- ・パーティクル



PS3-MT3

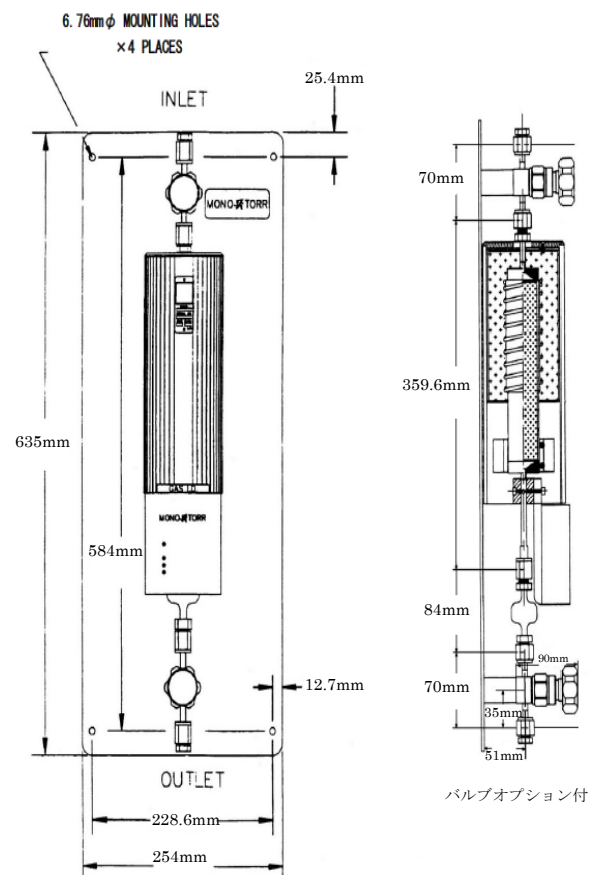
#### □寿命

定格流量で標準的なファイブ・ナインのガスを基準として1年 (具体的な寿命についてはお問い合わせください。)

□最大定格流量: 20slpm

□定格流量: 5slpm

□最大入口圧力: 0.97MPa



## 精製能力

不純物	希ガス	窒素
0-5slpm		
O <sub>2</sub>	<1 ppb	<1 ppb
H <sub>2</sub> O	<1 ppb	<1 ppb
CO	<1 ppb	<1 ppb
CO <sub>2</sub>	<1 ppb	<1 ppb
H <sub>2</sub>	<1 ppb	<1 ppb
CH <sub>4</sub>	<1 ppb	<1 ppb
N <sub>2</sub>	<1 ppb	N/A

## 標準仕様

	希ガス	窒素
定格流量(l/分)	5slpm	
最大定格流量(l/分)	20slpm	
操作温度(°C)	400	350
最大使用圧力	0.97MPa	
電力消費(ワット) 通常/最大	50/300	
最大圧力損失(kg/cm <sup>2</sup> )	0.7	
0.003 μ m フィルター	標準	
ライフ状態センサー	—	
インターロック機能	—	
バイパス・アッセンブリー	オプション	
配管継手 1/4VCR	標準	
電解研磨 Ra 10 μ inch	標準	
1/4"ダイヤフラム・バルブ	マニュアル	
バルブ駆動用エア	—	
重さ	6.0kg	
電源ケーブルの長さ	200cm	